

## Metrology PAN obradowali w WAT

23 kwietnia br. w Instytucie Optoelektroniki WAT odbyło się zebranie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka z Politechniki Wrocławskiej – członek korespondent PAN, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, założyciel i kierownik Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej. Dostojnych gości, w imieniu rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, powitał dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, który zaprezentował historię oraz profil działalności Instytutu. Następnie odbyły się zamknięte obrady, po których członkowie komitetu mieli okazję zwiedzić laboratoria oraz zapoznać się z pracami badawczymi prowadzonymi w instytucie Optoelektroniki, w tym również z pracami z zakresu metrologii optoelektronicznej.

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN ma 33 członków, przedstawiciele polskich uczelni wyższych, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Głównego Urzędu Miar, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wojskowego Centrum Metrologii MON, Wojskową Akademię Techniczną w składzie komitetu reprezentują: prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz (IOE), prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, czł. rzec. PAN (WTC), prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki (IOE) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski, emerytowany prof. zw. WAT.

Zakres działalności komitetu obejmuje: opracowywanie i analizę metod pomiarowych; pozyskiwanie, przetwarzanie i interpretację informacji ilościowej o zjawiskach elektrycznych i nieelektrycznych (optycznych, mechanicznych, fizykochemicznych, termicznych i innych); ocenę błędów i niepewności pomiaru. Podstawowe kierunki badań prowadzone przez komitet to: metody dedukcyjne i indukcyjne w modelowaniu matematycznym pól fizycznych, eksperymentalna ocena modeli pomiarowych, sensoryka (czujniki inteligentne, optoelektroniczne, sieci czujnikowe i inne), fuzja danych, cyfrowe przetwarzanie danych i sygnałów, algorytmizacja problemu odwrotnego, mikro- i nanosystemy pomiarowe, telemetria, pomiary biomedyczne, pomiary parametrów energii elektrycznej i procesów technologicznych, monitorowanie środowiska.

Komitet wydaje kwartalnik „Metrology and Measurement Systems” znajdujący się na liście filadelfijskiej oraz cykl książek „Problemy metrologii elektronicznej i fo-

tonicznej”. Jest organizatorem cyklicznej konferencji Kongres Metrologii.

**Ewa Jankiewicz**



Przy stole prezydyjnym. Od lewej: dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka oraz dr hab. inż. Józef Borkowski, prof. nadzw. PWR.



Goście mieli okazję zwiedzić laboratoria oraz zapoznać się z pracami badawczymi prowadzonymi w Instytucie Optoelektroniki. Na zdj. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki (pierwszy z prawej) opowiada o systemach wykrywania śladowych ilości substancji niebezpiecznych



Pamiątkowe zdjęcie członków Komitetu Metrologii i Aparatury PAN z dyrekcją i pracownikami Instytutu Optoelektroniki